GAMMA10セントラル部 SMBI入射実験における分光計測

筑波大学プラズマ研究センター 北出 崇二

研究背景・目的 実験装置 実験原理 実験結果

考察・まとめ

研究背景

- 2010年度から京都大学との双方 向型共同研究でGAMMA10に超 音速分子ビーム入射(Supersonic Moleculer Beam Injection : SMBI) 装置が設置された。
- SMBIはプラズマ中心部への燃料 粒子補給を目的としており、SMBI のプラズマへの効果を詳細計測す る必要がある。
- SMBI入射時の分光測定結果が 右図である。水素のバルマー系列 線の増加が確認できた。それに加 えて、炭素イオンからの放射も少 し増加していることが観測された。



研究目的

*SMBI*による燃料粒子補給の効果を計 測する。

> - 紫外・可視分光器を使用し、SMBI実験時の水素 バルマー系列線を計測する。衝突・輻射モデル (CR-model)を用いて、中性粒子密度の挙動を追う。 また、プラズマパラメータの変化も計算する。

*SMBI*による炭素イオンの発光増加の原
 因を追う。

- SMBI入射時の1価の炭素イオン(CII)スペクトル (283.76nm)を計測する。CR-modelを用いてCIIの 径方向密度分布を調べる。

GAMMA10



•GAMMA10

全長27mの直線型装置。 プラズマは、プラズマガ ン(PG)によって生成され、 イオンサイクロトロン周 波数帯発信機(ICRF)に よって加熱される。水素 プラズマを生成している。 セントラル部は主プラズ マ閉じ込め領域である。

•基本パラメータ $n_e = n_i \sim 2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ $T_e \sim 40 \sim 80 \text{ eV}$ $T_i \sim 5 \text{ keV}$

超音速分子ビーム入射装置 (Supersonic Molecler Beam Injection : SMBI)

- 超音速
 - パルスバルブを用いて高圧
 カで水素分子ガスをプラズマ
 中に高速で入射する。
- ・ 圧力・タイミング・パル
 スが調節可能
 - プレナム圧・入射タイミング・ パルス幅を調節し、プラズマ への入射粒子制御を行うこと ができる。
- ・ 使用圧力は0.5-1.5MPa
 - 普段使用している燃料粒子
 補給装置であるガスパフの
 50-150倍の圧力



紫外·可視分光計測器



原理と衝突・輻射モデル(CR-model)

・ 発光の原理

CR-model

- プラズマ中の線スペクトル放射は、主に電子との衝突によって中性粒子が励起し、 安定な状態に脱励起した時にエネルギーが空間に放出される現象。分光計測によって得られる放射スペクトル強度*I(i,j)*は、励起状態の占有密度*n(i)、*放射遷移確立 *A(i,j)*を用いて以下のように示すことができる。

$$I(i,j) = n(i)A(i,j)$$

電離進行プラズマ(n_e=10¹¹~10¹⁵cm⁻³)において 最も適した分光モデル。CR-modelでは。励起

・電離・再結合等のすべての素過程を考慮し

ている。電子・イオンの占有密度は以下の速

度方程式で示すことができる。

$$\begin{aligned} \frac{dn_{z}(i)}{dt} &= \left\{ \sum_{j \neq i} C_{z}(j,i) n_{e} n_{z}(j) + \sum_{j > i} A_{z}(j,i) n_{z}(j) \right\} - \left\{ \sum_{j \neq i} C_{z}(i,j) n_{e} n_{z}(i) + \sum_{j < i} A_{z}(i,j) n_{z}(i) \right\} \\ &+ \left\{ \sum_{i} S_{z-1}(i,i) n_{e} n_{z-1}(i) \right\} - \left\{ \sum_{k} S_{z}(i,k) n_{e} n_{z}(i) \right\} \\ &+ \left\{ \sum_{k} \alpha_{z+1}(k,i) n_{e} n_{z+1}(k) \right\} - \left\{ \sum_{i} \alpha_{z}(i,i) n_{e} n_{z}(i) \right\} \end{aligned}$$

中性粒子・電子密度の算出

- 中性粒子密度
 - CR-modelにおいて、水素の場合、速度方程式を解くことができる。励起準位*i*における原子の数*n(i)*は、水素の中性粒子密*n_Hとポピュレーション*係数*R_i(i)*を用いて以下で表せる。 $n(i) = R_1(i)n_en_H$
 - 放射スペクトル強度は以下で表せる。

$$I(i, j) = n(i)A(i, j) = R_1(i)n_e n_H A(i, j)$$

CR-model 電子密度 0.18 0.17 - 放射スペクトル強度の比は以下の式 トムソン散乱計測で ۳ 0.16 で表すことができる。 得られた電子温度 得られた .15 $I(i.j) \ R_1(i)A(i,j)$ 発光強度比 .14 $I(j,k) \quad R_1(j)A(j,k)$ 2 0.13 - ポピュレーション係数は電子温度・電 0.12 子密度に依存する関数である。した がって、発光強度比・電子密度を実験 6 1 0¹² から求めることができれば電子密度 Electron Density[cm⁻³] を算出することができる。

炭素イオン密度分布の算出

R

➤ Y

line of sight

- 体積輻射率
 - 可視・紫外分光器で得られる放射輝度は視線席 分量*I(s)*である。単位堆積あたりの放射輝度であ る体積輻射率*E(r)*に変換するためアーベル変換 を使用する。アーベル変換を以下の式に表す。

$$E(r) = -\frac{1}{\pi} \int_{r}^{R} \frac{dI(s)}{dx} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - r^2}}$$



- z価イオンの*i*準位の占有密度は、体積輻射率*E(r)*と放射遷移確立*A(i,j)*を用いて以下の式で表せる。______



- CR-modelから*i*準位の占有密度とz価イオン全体の密度の比*n_(i)*を計算する。 z価イオン全体の密度は以下の式で表すことができる。

$$n_z = \frac{n_z(i)}{n_z'(i)} = \frac{E_i}{n_z'(i)A_z(i)}$$





中性粒子密度の変化



- 中性粒子密度
 - 中性粒子密度が大きく上昇して
 いることが確認できる。

・ SMBIの効果

 - プラズマの中心部まで中性粒子 密度が30-50倍に上昇している
 。プラズマの中心部まで粒子補 給できていることが確認できた。

誤差

X=-12,13cmのところで100倍
 以上になっている。これはSMBI
 入射前の信号が弱いことによる
 誤差と考えられる

CR-modelで求めた電子密度

SMBI

SMBI入射前[113.9-123.9ms]



- エラーバーは、トムソン散乱で求めた電子温度の誤差。
- 多くのn_e=2×10¹²cm⁻³に近い密度 になっている。
- マイクロ波で求めた密度は n_e=2×10¹²cm⁻³程度。





- x [cm] ・ プラズマの中心部の密度はn_e=3×10¹²cm⁻³ 程にみえる。
- X>0の部分はエラーが大きい可能性がある。
- マイクロ波で計測した結果は n_e=2.3×10¹²cm⁻³程度。
- マイクロは干渉計は計測している視線方向 が異なる。
- H_αとH_βは異なるショットで計測している。





考察:炭素イオン密度の増加

SMBI装置は水素ガスを噴射している。 今回の実験で、SMBI入射時にCII密度が増加していることが確認できた。 その原因を次のように考察した。



CR-modelを用いたCIIの密度と励 起状態の占有密度との密度比

• スパッタリング

SMBI入射により、プラズマの径が大きくなったことで、リミターからの炭素が頻繁に叩き出された。

 電子温度の減少によって多価イオン (CIII,CIV)からの再結合が増加した。

• アーベル逆変換

– 今回の解析では、軸対象プラズマを 仮定としたアーベル逆変換を行って いる。これによる誤差

まとめ

 本研究では可視・紫外分光器を使用して、スペクトルの径方向分布を計測した
 ・得られた結果をCR-modelに適用することで、径方向の電子密度分布、1価の炭素イオン (CII)の密度分布を計算した。

•中性粒子密度分布•電子密度分布

- SMBI装置によって、プラズマ中心部への燃料粒子補給ができていることが確認できた。
- SMBI入射によって電子密度が増加していることが確認できた。
- - 衝突・輻射モデルから算出した電子密度はマイクロ波干渉計でもとめた電
 - 子密度より大きかった。

・炭素イオン密度分布

- SMBI入射時のCIIの放射輝度が強くなることが確認できた。
- CIIの密度分布は増加している結果となった。

今後の課題

- •非軸対象であるプラズマのアーベル逆変換について検討する。
- •他の不純物を計測する。
- •粒子補給の効果についてより、詳細に調べる。